

高真空アニール装置 SAF-52T-II

効率的なサイクルタイム/省スペース化

High Vacuum Annealing Furnace



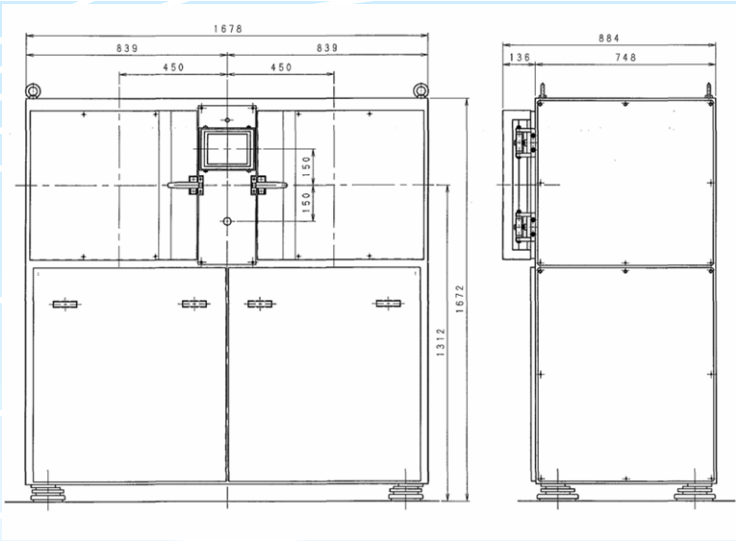
内部機構



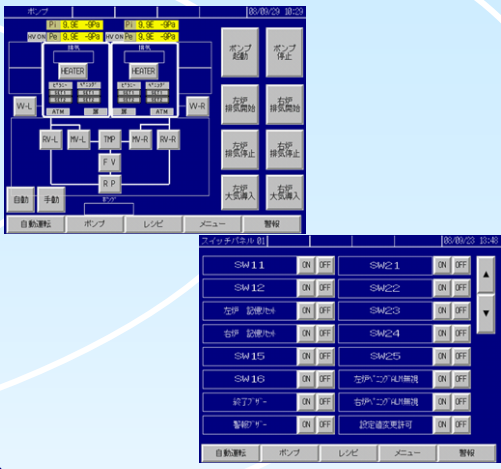
特徴

1. 本装置は、主に水晶振動子などの加工時に生ずる内部応力の歪みの除去、電極膜の安定化のための熱処理を行うことを目的として開発された装置です。
2. W460×D350×H35mm の加熱棚が左右計 10 段、170×134mm の標準トレーを最大 60 枚収納可能です。
3. 独立して稼動可能な処理室を 2 室有しており、生産の効率化、サイクルタイムの短縮が図れます。

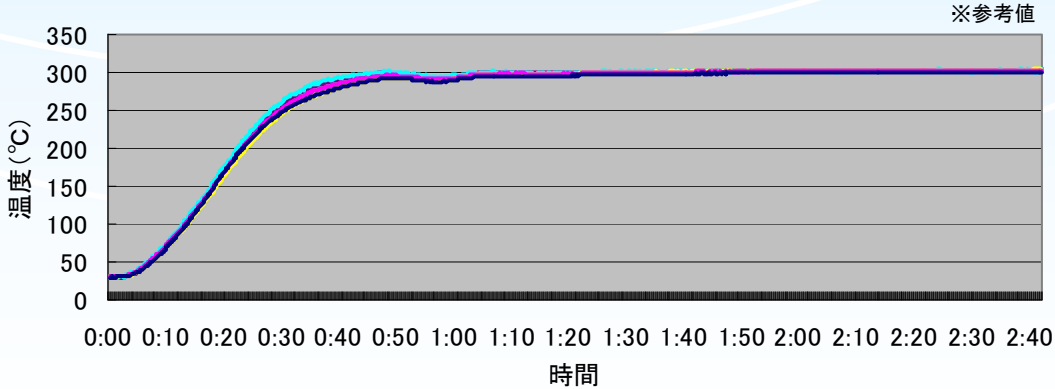
外観図



タッチパネル図



温度分布データ



各棚段の中央部の
表面温度を測定

所要諸元及び性能

●装置名		●性能	
●装置型式	高真空アニール炉	到達圧力	6.7 × 10 ⁻⁴ Pa以下(2槽排気)
●寸法・重量	SAF-52T	排気時間	6.7 × 10 ⁻³ Pa迄20分(2槽排気)
巾 × 奥行き × 高さ	W1700mm × D900mm × H1700mm	最高温度	300℃ (試料用トレーの中央部の表面温度)
装置重量	1200Kg	常用温度	250℃ (試料用トレーの中央部の表面温度)
●所要諸元		温度調整精度	±15℃以内 (250℃にて、試料用トレーの中央部の表面温度)
所要電力量	3相, 200V, 22.4KVA(64.7A)	昇温時間	常温より250℃に達する迄約60分
所要水量	入圧: 0.3~0.4MPa 差圧: 0.2MPa以上 水温: 20~25℃(但し、運転中結露無き事) 流量: 約0.66m ³ /hr(11L/min)	処理数	60枚(ワークトレー170mm × 134mmにて)
所要空圧	供給圧: 0.5~0.7MPa 設定圧: 0.5MPa	排気系	ターボ分子ポンプ、ロータリーポンプ
所要ガス (N2ガスリーク用)	供給圧: 0.2MPa以上 設定圧: 0.05~0.1MPa	真空計	ペニング真空計 × 2、ピラニ真空計 × 2

※本仕様・外観については、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

お問合せ先
【営業部】

ご質問・詳細につきまして
は、営業所までお気軽にお
問合せ下さい。

TEL : 042-764-0370 FAX : 042-764-0377

E-Mail : sales-pamphlet@showashinku.co.jp



株式会社 昭和真空
SHOWA SHINKU CO., LTD.

本社・相模原工場 〒229-1124 神奈川県相模原市田名 3062-10 TEL: 042-764-0321
URL <http://www.showashinku.co.jp>

本製品は、外国為替並びに外国貿易管理法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当する場合があります。従って、日本国外に該当品を持ち出す際は、日本国政府への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。